

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number : 02-017429

(43) Date of publication of application : 22.01.1990

(51) Int. CI. G01N 21/39

(21) Application number : 63-168077 (71) Applicant : FUJITSU LTD

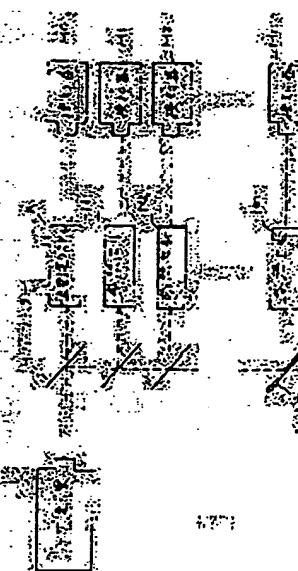
(22) Date of filing : 05.07.1988 (72) Inventor : SAWADA AKIRA
DOI SHOJI
SUGIYAMA IWAO

(54) CONCENTRATION MEASURING METHOD BY USING LASER TYPE GAS SENSOR

(57) Abstract:

PURPOSE: To make the optical system of an apparatus compact by using one laser light source without using many expensive laser sources.

CONSTITUTION: One laser light source Lo which emits light in a wavelength region wherein absorption lines of (n) kinds of gas species are presents is arranged. The laser light emitted from the laser light source Lo is split. The split laser light beams are transmitted through a cell for gas to be measured and (n) pieces of reference cells N1-Nn each containing one kind of (n) kinds of the gas species. An absorption spectrum each comprising (i) points is obtained. The signal value of each point is obtained by using the reference cells N1-Nn. The inverse matrix $1/(B \times A)$ of the product $B \times A$ of a matrix A comprising (i) raw and (n) column with said signal values as elements and the transposed matrix B of said matrix is computed. The signal value of each point is obtained by using the gas to be measured, and the product $B \times C$ of a matrix C comprising (i) raws and one column and a transposed matrix B is computed. Furthermore, $1/(B \times A) \times (B \times C)$ is computed. In this way, the concentrations of the (n) kinds of the gas species incorporated in the gas to be measured can be computed. The optical system of the apparatus can be made compact.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

⑫公開特許公報(A) 平2-17429

⑬Int.Cl.

G 01 N 21/39

識別記号

庁内整理番号

7458-2G

⑭公開 平成2年(1990)1月22日

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

⑮発明の名称 レーザ方式ガスセンサによる濃度測定方法

⑯特 願 昭63-168077

⑰出 願 昭63(1988)7月5日

⑱発明者 澤 田 充 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社
内⑲発明者 土 肥 正 二 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社
内⑳発明者 杉 山 勝 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社
内

㉑出願人 富士通株式会社 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

㉒代理人 弁理士 井桁 貞一

明細書

1. 発明の名称

レーザ方式ガスセンサによるガス濃度測定方法

2. 特許請求の範囲

波長可変のレーザ光源より放射されるレーザ光を被測定ガス中に透過させ、その透過光のスペクトル強度を光検知器によつて電気信号に変換し、その電気信号に基づいて前記被測定ガスの濃度を算出して後出するレーザ方式ガスセンサにおいて、
 n種のガス種の吸収線が存在する波長領域で発光する1個のレーザ光源を配設し、該レーザ光源から放射されるレーザ光を分割して、分割したレーザ光それぞれを被測定ガスセルおよび前記n種のガス種の1種を収容したn個の参照セルに透過させて、各々の1ポイントからなる吸収スペクトルを求める。

$$\left[\begin{array}{c} \Sigma_1 (X_{1,1})^2 \cdots \Sigma_1 (X_{1,n} X_{n,1}) \\ \vdots \\ \Sigma_n (X_{1,1} X_{1,n}) \cdots \Sigma_n (X_{n,1})^2 \end{array} \right]$$

$$\times \left[\begin{array}{c} \Sigma_1 (X_{1,1} Y_1) \\ \Sigma_1 (X_{1,2} Y_1) \\ \vdots \\ \Sigma_1 (X_{1,n} Y_1) \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{c} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{array} \right]$$

(但し、 $X_{1,1} \sim X_{n,n}$ は参照セルを透過したスペクトル信号値、 $Y_1 \sim Y_n$ は被測定ガスセルを透過したスペクトル信号値、 $a_1 \sim a_n$ はn種のガス濃度)

なる演算をおこなつて、前記被測定ガスに含まれる前記n種のガス種の濃度を算出するようにしたことを特徴とするレーザ方式ガスセンサによるガ

又稱度測定方法。

3. 発明の詳細な説明

· (母 妻)

レーザ光を用いて複数ガス種の濃度を検知する
レーザ方式ガスセンサによるガス濃度測定方法に
關し、

1個のレーザ光源を用いて光学系を小型化することを目的とし、

レーザ光源より放射されるレーザ光を被測定ガス中に透過させ、その透過光のスペクトル強度を光検知器によって電気信号に変換し、その電気信号に基づいて前記被測定ガスの濃度を算出して検出するレーザ方式ガスセンサにおいて、

n種のガス種の吸収線が存在する波長領域で発光する1個のレーザ光源を配設し、該レーザ光源から放射されるレーザ光を分割して、分割したレーザ光それぞれを被測定ガスおよび前記n種のガス種の1種を収容したn個の参考セルに透過させて、各々1ポイントからなる吸収スペクトルを求め、

が他のガス種と区別がつき易い波長領域を選んで、その波長領域のスペクトル強度を測定し、かくして、 n 個所の波長領域を選んで、そのような波長領域を発光するレーザ光源を用いて、それぞれ n 個のスペクトル強度を測定する。そして、得られたスペクトル信号値の行列を演算装置によって求める。一方、各々のガス種の既知濃度のスペクトル信号値を測定して、その信号レベルと既知濃度との比を n 行 n 列の行列で求め、その逆行列を計算して補正係数とし、その補正係数の逆行列を前記の行列に乗算して補正し、そのようにして、 n 種のガス種の濃度を算出していた（特願昭 62-230251 号参考）。

しかし、そのような濃度測定方法によれば、重なりの様子が異なつて区別がつき易い複数の波長領域におけるスペクトルを測定するために、該測定ガスの種類だけ波長の異なるn個のレーザ光源が必要であり、そのため、高価なレーザ光源を多数使用して、ガスセンサ装置の光学系が大型化する欠点があつた。

多頭セルを用いて得た各ポイントの信号値を要素とした1行n列の行列Aと、該行列の転置行列Bとの積 $B \times A$ の逆行列 $1/(B \times A)$ 、および被測定ガスを用いて得た各ポイントの信号値を要素とする1行1列の行列Cと前記転置行列Bとの積 $B \times C$ を計算し、更に $1/(B \times A) \times (B \times C)$ なる演算をおこなつて、前記被測定ガスに含まれる前記n種のガス種の濃度を算出するようにしたことを行つた。

(産業上の利用分野)

本発明はレーザ光を用いて複数ガス種の濃度を検知するレーザ方式ガスセンサによるガス濃度測定方法に関する。

(従来の技術と発明が解決しようとする課題)

従来、吸収スペクトルの異なる n 種のガス種の各々の濃度を測定する場合、まず、重なりの様子の各々異なる n 個所の波長領域における吸収スペクトルを測定する。即ち、 n 種中の 1 つのガス種

第6図はその従来のガスセンサにおける光学系を示す例で、 L_1 , L_2 — L_5 はレーザ光源、 K は被測定ガスセル、 N_1 , N_2 — N_5 は既知の濃度の1つのガス種を収容した参照セル、 M_{11} , M_{12} , M_{21} — M_{22} , M_{31} は検知器、 H はハーフミラー、 R はレンズ、 M はミラーである。

例のように、異なる波長領域をもつたn個のレーザ光源を設け、区別し易い波長領域をもつ1つのレーザ光源からのレーザ光を被測定ガスと相鉛。濃度が既知の1つの参照ガスとを比較し、かくして、n個の参照ガスと比較して、上記したように行列で求め、補正係数の逆行列を乗算してn種のガス種の濃度を算出していた。

本発明はそのような多くの高価なレーザ光源を用いることなく、1個のレーザ光源を用いて光学系を小型化することを目的としたガスセンサを從属するものである。

(課題を解決するための手段)

その際は、第1圖に示す關理圖のように、 α

種のガス種の吸収線が存在する波長領域で発光する1個のレーザ光源し。を配設し、該レーザ光源から放射されるレーザ光を分別して、分割したレーザ光それぞれを被測定ガスセルKおよび前記n種のガス種の1種を収容したn個の参照セルN₁～N_nに透過させて、各々1ポイントからなる吸収スペクトルを求め、下記式からなる演算をおこなつて、被測定ガスに含まれる前記n種のガス種の濃度を算出するようにしたガス濃度測定方法によつて解決される。尚、第1図においてM₁～M_nは検知器、Hはハーフミラー、Mはミラーである。

(作用)

即ち、本発明はレーザの1つのモード（モードホップのない連続的に波長を変える領域：20～50nm範囲）によつてn個のガス種の吸収スペクトルを測定し、次の信号処理を演算装置によりおこなわせる。

その信号処理の説明を簡単にするためにn=2

の場合について説明する。波長領域を1～100nm

に等分割して、N₁ガスを収容した参照セル

N₁による単位濃度当りのスペクトル信号値を

$$(X_{1,1}, X_{1,2}, \dots, X_{1,100})$$

N₂ガスを収容した参照セルN₂による単位濃度当りのスペクトル信号値を

$$(X_{2,1}, X_{2,2}, \dots, X_{2,100})$$

被測定ガスを収容した被測定ガスセルKによる単位濃度当りのスペクトル信号値を

$$(Y_{1,1}, Y_{1,2}, \dots, Y_{1,100})$$

とし、被測定ガス中のN₁ガスとN₂ガスの濃度が各々aとbであれば、

$$\begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \vdots \\ Y_{100} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_{1,1} & X_{2,1} \\ X_{1,2} & X_{2,2} \\ \vdots & \vdots \\ X_{1,100} & X_{2,100} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$$

なる関係が成立し、これを書き換えると、

$$\begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \vdots \\ Y_{100} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_{1,1} & X_{2,1} & \dots & X_{1,100} \\ X_{1,2} & X_{2,2} & \dots & X_{1,100} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ X_{1,100} & X_{2,100} & \dots & X_{1,100} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$$

が成立する。この式の両辺に、

$$\begin{bmatrix} X_{1,1} & X_{1,2} & \dots & X_{1,100} \\ X_{2,1} & X_{2,2} & \dots & X_{2,100} \end{bmatrix}$$

を掛け合わせると、

$$\begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \vdots \\ Y_{100} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_{1,1} & X_{1,2} & \dots & X_{1,100} \\ X_{2,1} & X_{2,2} & \dots & X_{2,100} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \vdots \\ Y_{100} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_{1,1} & X_{2,1} & \dots & X_{1,100} \\ X_{1,2} & X_{2,2} & \dots & X_{1,100} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ X_{1,100} & X_{2,100} & \dots & X_{1,100} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$$

になり、

$$\begin{bmatrix} \sum_j X_{1,j} & Y_1 \\ \sum_j X_{2,j} & Y_2 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} \sum_j (X_{1,j})^2 & \sum_j (X_{1,j} X_{2,j}) \\ \sum_j (X_{2,j})^2 & \sum_j (X_{1,j} X_{2,j}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$$

になる。この式の両辺に、

$$\begin{bmatrix} \sum_j (X_{1,j})^2 & \sum_j (X_{1,j} X_{2,j}) \\ \sum_j (X_{2,j})^2 & \sum_j (X_{1,j} X_{2,j}) \end{bmatrix}^{-1}$$

即ち、逆行列をかけると、

$$\begin{bmatrix} \sum_j (X_{1,j})^2 & \sum_j (X_{1,j} X_{2,j}) \\ \sum_j (X_{2,j})^2 & \sum_j (X_{1,j} X_{2,j}) \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \sum_j X_{1,j} & Y_1 \\ \sum_j X_{2,j} & Y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \quad \text{---(I)}$$

になる。即ち、

$$(X_{1,1}, X_{1,2}, \dots, X_{1,100}),$$

$$(X_{2,1}, X_{2,2}, \dots, X_{2,100}),$$

$$(Y_1, Y_2, \dots, Y_{100})$$

を測定して、上式の演算をおこなえば被測定ガス内のN₁ガスとN₂ガスとの濃度a, bを求める

ことができる。

被測定ガスが3種類以上でもハーフミラー、各
屈セルを増やせば同様であり、ガス種をn、濃度
を a_1, a_2, \dots, a_n として、

$$\begin{aligned} & \left[\sum_j (X_{1,j})^2 \dots \sum_j (X_{n,j})^2 \right] \\ & \left[\sum_j (X_{1,j} X_{2,j}) \dots \sum_j (X_{n,j} X_{1,j}) \right] \\ & \times \left[\begin{array}{c} \sum_j (X_{1,j} Y_j) \\ \sum_j (X_{2,j} Y_j) \\ \vdots \\ \sum_j (X_{n,j} Y_j) \end{array} \right] \\ & = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \end{aligned}$$

の演算をおこなえば、被測定ガスの濃度を求める
ことができる。

上記の演算をおこなえば、レーザの1モードに
よってn種のガス種の吸収スペクトルを測定でき、

1つのレーザ光源のみを用いたガスセンサが構成
できる。

(実施例)

以下、図面を参照して実施例によつて詳細に説
明する。

例えば、被測定ガスがN₂ガスとN₂ガスとの
2種類からなり、それぞれがa₁, a₂の濃度で含まれ
ているとすると、演算は(1)式でおこなうことが
でき、第2図に示すガスセンサの光学系の構成に
なる。なお、第2図において、図中の記号は第1
図と同一部位に同一記号が付けてあり、Rはレン
ズである。

第3図はスペクトル信号を処理する信号処理回
路図を示しており、上記に説明した以外の記号は
11, 12, 13はロックインアンプ回路、21, 22, 23
はパワー測定回路、31, 32, 33, 34, 35, 36はサ
ンブルホールド回路、40はマルチブリクサ回路、
45はA/Dコンバータ、50は演算装置(マイクロコ
ンピュータ)、55はレーザの制御電源である。本

発明では、例えば、測定しようとする波長領域を
100ポイント(=1)に区分して波長数を順次
に変え、それを変換するが、そのための1～
100ポイントのレーザ電流の変化図を第4図に示
しており、演算装置50からの指示により制御電源
55によつてレーザ電流を図のように変化させる。
そして、光は検知器M₁～M₄によって電気信号に
変換される。ロックインアンプ回路は、二次
高調波の成分を検出する。また、パワー測定回路
では電流カット時にスペクトル強度を検出する。
それらはサンブルホールド回路、マルチブリクサ
回路40を経て順次にA/Dコンバータ45でデジタル
信号に変換され、それが演算装置50で計算されて
出力される。

第5図は実測ガスの二次微分スペクトルを例示
しており、被測定ガスがエタン(C₂H₆)と
プロパン(C₃H₈)との2種類であり、第1図(a)
は参考セルN₁内のプロパンガスのスペクトル、
同図(b)は参考セルN₂内のエタンガスのスペクト
ル、同図(c)は被測定ガスのエタンガスとプロパン

ガスとを含むスペクトルであつて、このようなス
ペクトルが100ポイントに区分されて検知され、
上記(1)式より演算・補正されて各々の濃度が検知
されるものである。

なお、前記した従来法では二次微分スペクトル
の特徴ある2～3ポイントのみを選んで算出して
いたが、本発明にかかる測定方法では細かく区分
した多数ポイントからなるスペクトル波形を描き
だして算出することが大きく相違している点であ
る。

(発明の効果)

以上の説明から明らかなように、本発明にかかる
濃度測定方法によれば高価なレーザ光源を多數
用いることなく、1個のレーザ光源を用いてレ
ーザ光源および検知器を含む光学系を小型にし、ガ
スセンサを安価に作成することができる利点の大
きいものである。

4. 図面の簡単な説明

第1図は原理図。

第2図は実施例の光学系を示す図。

第3図は信号処理回路図。

第4図はレーザ電流の変化図。

第5図は実測ガスの二次散分スペクトル図。

第6図は従来の光学系を示す図である。

図において、

L₀ はレーザ光源。

K は被測定ガスセル。

N₁ ~ N₃ は参照セル。

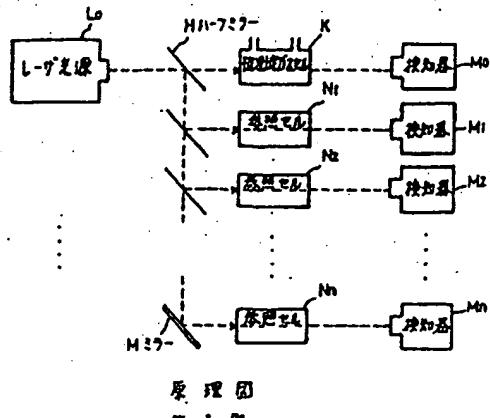
M₀ ~ M₃ は検知器。

H はハーフミラー。

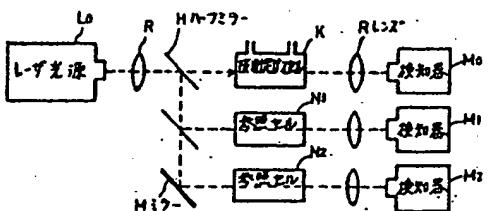
M はミラー。

を示している。

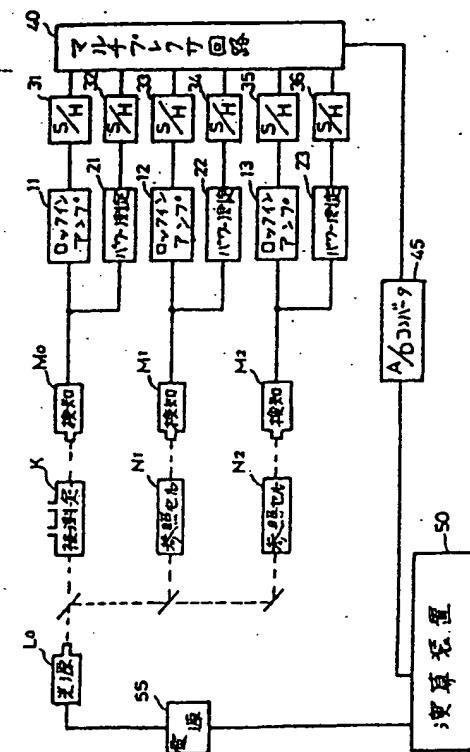
代理人弁理士 井桁 貞一



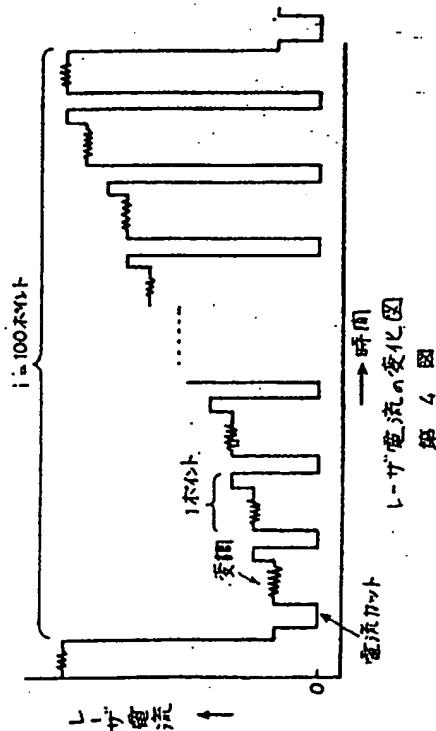
原理図
第1図



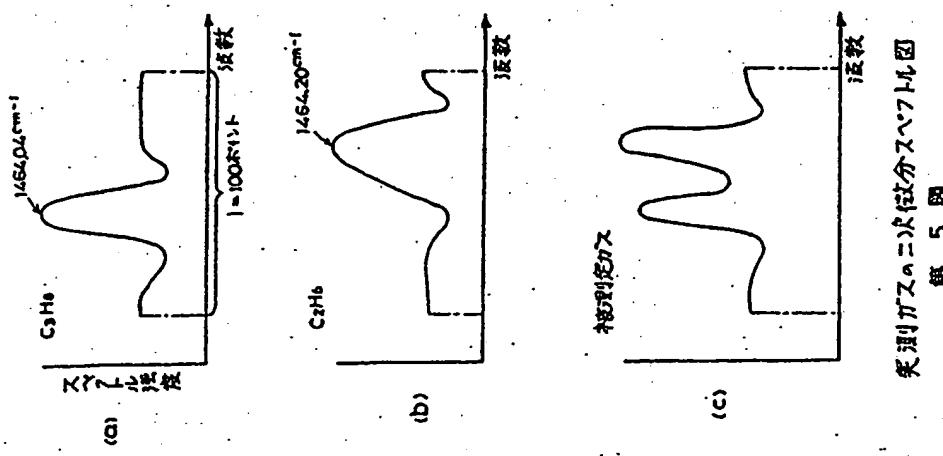
実施例の光学系を示す図
第2図



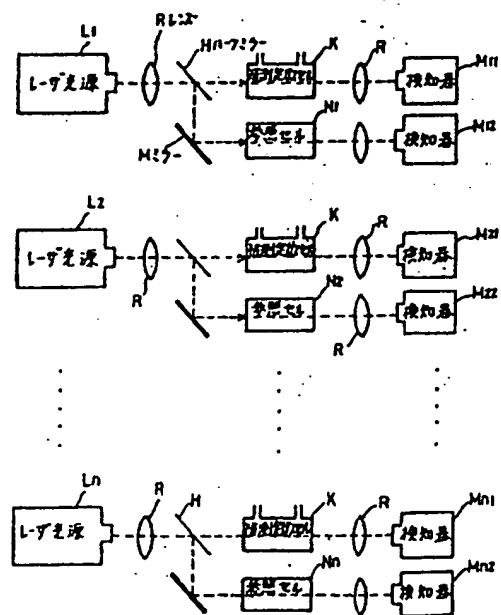
信号処理回路図
第3図



レーザ電流の変化図
第4図



実測ガスの二重吸収スペクトル図
第5圖



従来の光学系の構成図

第6圖